**Prijavnica za šolanje na opremi CEMM**

**1. Osebni podatki**

Ime: Priimek:

Telefon: E-pošta:

Mobilni telefon:

Institut: Odsek:

Status:

podiplomski študent (magisterij, doktorat)

podoktorski sodelavec

znanstveni ali strokovni sodelavec

zunanji sodelavec

drugo:

**2. Področje šolanja**

SEM priprava  SEM  TEM priprava  TEM

Utemeljitev šolanja:

Preiskovani materiali (spojine, morfologija, …)

Pričakovani rezultati:

Pričakovana pogostost dela na opremi za EM:

vsak dan  2-3x/teden  1x/teden  1x/2 tedna  1x/mesec

drugo:

Predvideno obdobje dela na opremi za EM:

do enega leta  do dveh let  do treh let  do štirih let  več kot štiri leta

drugo:

**3. Predznanje kandidata(ke)**

Opravljen izpit iz predmeta MMM na MPŠ:  da  ne

Opravljen izpit iz predmeta SM na MPŠ:  da  ne

Poslušatelj/ica predmeta MMM na MPŠ:  da  ne

Poslušatelj/ica predmeta SM na MPŠ:  da  ne

Drugo:

Obstoječa licenca za delo na opremi za mikroskopijo:  da  ne

Mikroskop(i)/priprava vzorcev:

**4. Izjava**

Podpisani se strinjamo, da v primeru poškodbe opreme/instrumentov za elektronsko mikroskopijo in pripravo vzorcev v okviru CEMM, ki bi bila posledica nestrokovnega in nepazljivega ravnanja sodelavca/ke našega odseka/laboratorija/centra, stroške popravila krije naša enota IJS.

Podpis mentorja: Podpis vodje enote:

Datum prijave:

**Izjava kandidata(tke) za šolanje na opremi za elektronsko mikroskopijo**

Podpisani kandidat(tka) za šolanje na opremi za elektronsko mikroskopijo v CEMM izjavljam, da bom pri delu na opremi za elektronsko mikroskopijo/pripravo vzorcev spoštoval pravila za delo na opremi za elektronsko mikroskopijo in da bom v prostorih CEMM vzdrževal red in čistočo po opravljenem delu. Nadalje bom vsako napako v delovanju opreme takoj sporočil osebju CEMM. Ravno tako sem seznanjen, da mi bo ob nespoštovanju pravil in/ali ob neustreznem rokovanju z opremo odvzeta licenca za delo na opremi CEMM.

Podpis kandidata:

Datum: